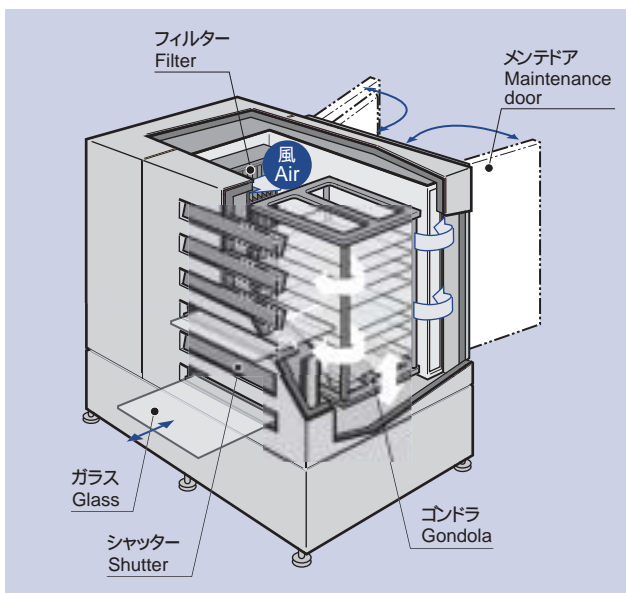
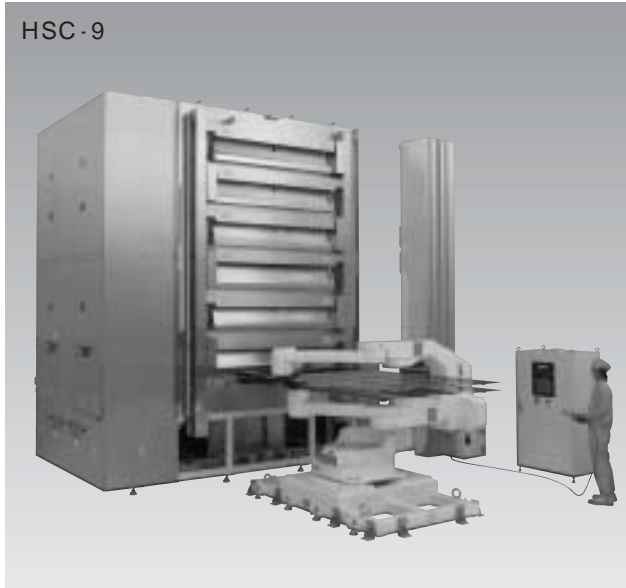


FPD用クリーンオーブン(HSCシリーズ) Clean Oven for FPD (HSC series)



特長

- ガラス基板はサポートピンのみで受けており、たわみを最小限に抑え、サーマルイメージの低減にも効果を発揮します。昇華物対応(オプション)
- 装置内のエアは常に循環しており、揮発した化学物質を含むガスを換気回路で高温のフレッシュエアと混合させ濃度を下げ、排気ダクトより排出します。
- シャッター開閉口からエアの飛散を防止するため、シャッター部前後でエアを吸引します。
- シャッター前の吸引をより効果的に行えるよう、シャッター開閉口下部にエアブローを取付。
- ロボットエリアにおいても天井 / 床部に排気機構を装備できます。

仕様(例)

対応ガラスサイズ	最大サイズ第8世代
温度範囲	+100 ~ +300
温度分布	±4.5 (ガラス表面温度at +230)

Features

Supporting a substrate horizontally by pins which are placed on a substrate rack from below reduces "Thermal Image" failures.

Countermeasures against Sublimates (Option)

- To reduce concentration of chemicals vaporized from glass substrates in the oven, a ventilating system takes in fresh air, this air is heated by a heater, and makes the air circulate.
- A sucking system installed on a shutter slit area sucks a leaking air to prevent diffusion.
- We installed Air-Blow system on under-side of shutter slit area to make more definitive exhaust.
- To keep your clean-room more cleanly, ceiling / under floor exhaust system can be installed in robot module.

Specifications (Example)

Processing glass size	Max. 8th generation glass
Operating range	+100 ~ +300
Temperature uniformity	±4.5 (at +230 on the glass surface)